

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出新型光罩检测系统*Teron 检测系统和光罩决策中心实现集成电路产业最复杂光罩的品质检验*

【美国加州 MILPITAS 2016 年 8 月 16 日讯】今天，[KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）针对 10 纳米及以下的掩膜技术推出了三款先进的光罩检测系统，Teron™ 640、Teron™ SL655 和光罩决策中心 (RDC)。所有这三套系统是实现当前和下一代掩膜设计的关键，使得光罩厂和集成电路晶圆厂能够更高效地辨识光刻中显著并严重损害成品率的缺陷。

利用创新的双重成像技术，Teron 640 检测系统为光罩厂提供了必要的灵敏度，对先进的光罩进行准确的品质检验。Teron SL655 检测系统采用全新的 STARlightGold™ 技术，帮助集成电路制造商评估新光罩的质量，监测光罩退化，并检测对成品率至关重要的光罩缺陷。Teron 检测机台的综合光罩质量测量是由光罩决策中心 (RDC) 所支持的，RDC 是一套数据分析与管理系统，具备多种功能，支持缺陷的自动识别判断，缩短生产周期，并减少影响成品率的与光罩相关的掩模图案错误。

KLA-Tencor 的光罩产品事业部 (RAPID) 副总裁兼总经理熊亚霖博士称：“今天的复杂的成像技术，例如隔板辅助四层成像 (SAQP)，采用越来越复杂的光罩，这使得检验光罩质量并保持光罩状况对实现最佳的晶圆图案成像至关重要。我们的团队已经开发出最先进的光罩检测与数据分析技术，将满足当前和下一代光罩设计的需求。通过将 Teron 640 和 Teron SL655 生成的大量数据与 RDC 的评估功能紧密结合，光罩厂和集成电路晶圆厂能够更高效地辨识光刻中显著的光罩缺陷，从而改善光罩的质量控制，并获得更好的产品图案成像。”

Teron 640 是建立在光罩业界领先的 Teron 光罩检测平台之上，通过采用 193 纳米光源和双成像模式（结合了高分辨率检测和基于缺陷成像性识别的空中成像），Teron 640 支持先进的光学光罩检测。此外，Teron 640 还增强了先进的芯片-数据库 (die-to-database) 检测算法，以进一步提高缺陷灵敏度，并提供新的更高产能选项，以缩短获取结果的时间。多套 Teron 640 光罩检测系统已经安装在晶圆代工厂和逻辑电路工厂中，用于高性能光罩的质量控制。

Teron SL655 的核心技术 STARlightGold 能够在新光罩质量检查时从光罩生成黄金参考，然后使用此参考进行光罩合格性的重新检测。这种独特的技术实现了全域光罩覆盖，并且创造出最佳的缺陷检测率，例如雾点生长或污染，籍此支持包括采用高度复杂的光学邻近技术在内的各种光罩类型。Teron SL655 拥有业界领先的产能，支持更快的生产周期和检测更多数量的光罩，满足先进的多图案技术光罩技术。此外，Teron SL655 与超紫外线 (EUV) 检测技术兼容，能够与集成电路制造商及早协作，满足晶圆厂对 EUV 光罩的要求。在新光罩质量控

制和芯片生产过程中的光罩合格性重新检定方面，Teron SL655 系统正在接受集成电路制造商的评估。

RDC 是一套综合数据分析和存储平台，支持光罩厂和集成电路晶圆厂的多种 KLA-Tencor 光罩检验与测量平台。RDC 可以提供包括自动缺陷分类 (ADC) 在内的数种应用，ADC 与检测机台及光刻平面检查 (LPR) 同时运行，而 LPR 则用于分析光罩检测仪所检出缺陷的成像性。这些应用可以让缺陷识别自动化，从而改善周期时间，并减少关键性错误。RDC 已被多家代工厂和内存制造商采用，对光罩合格检验过程中的数据管理和分析。

Teron 640、Teron SL655 和 RDC 与 [LMS IPRO6](#) 光罩图案放置量测系统和 [K-T Analyzer®](#) 先进数据分析系统一起，形成了全面的光罩合格性检定解决方案，以支持先进的光罩和集成电路制造商。Teron 640、Teron SL655 和 RDC 也是 KLA-Tencor 的 5D Patterning Control Solution™ 的关键组成部分，它可以帮助集成电路制造商通过对整个晶圆厂和光罩厂的工艺监测与控制获得更好的图案成像的成果。为了保持前沿领先的掩膜和集成电路制造所要求的高性能和高产能，Teron 640、Teron SL655 和 RDC 由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。关于更多信息，请参阅 [5D 图案成型控制解决方案网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、发光二极管 (LED) 及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，四十年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 Teron 640 和 Teron SL655 光罩检测系统的预期性能，Teron 640 和 Teron SL655 光罩检测系统相对于未来技术节点的可扩展性，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 Teron 640 和 Teron SL655 光罩检测系统的预期使用，以及 Teron 640 和 Teron SL655 光罩检测系统使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###